

## 令和元年度退職教員の紹介

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 部 局 名   | 大学院工学系研究科・工学部   |  |
| 氏 名     | 高増 潔  |   |
| 職 名     | 教授  |   |
| 本学在職期間  | 平成 5 年 4 月～令和 2 年 3 月   |   |
| 所 属     | 精密工学専攻 精密情報システム工学講座   |   |
| 専 門 分 野 | 精密測定学   |   |
| 略 歴     | <p>昭和 52 年 3 月 本学工学部卒業</p> <p>昭和 57 年 3 月 本学大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士</p> <p>昭和 57 年 4 月 本学工学部助手</p> <p>昭和 60 年 4 月 東京電機大学工学部講師</p> <p>昭和 62 年 10 月 東京電機大学工学部助教授</p> <p>平成 5 年 4 月 本学工学系研究科助教授</p> <p>平成 13 年 11 月 本学工学系研究科教授</p>  |   |
| 研 究 内 容 | <p>Takamasu, Kiyoshi (共著) "Basic Concept of Feature-Based Metrology." <i>Measurement</i> 26 (1999): 151-156.</p> <p>Takamasu, Kiyoshi (共著) "Linewidth roughness of advanced semiconductor features using focused ion beam and planar-transmission electron microscope as reference metrology." <i>Journal of Micro/Nanolithography MEMS and MOEMS</i> 17 (2018): 041010 1-7</p> |   |